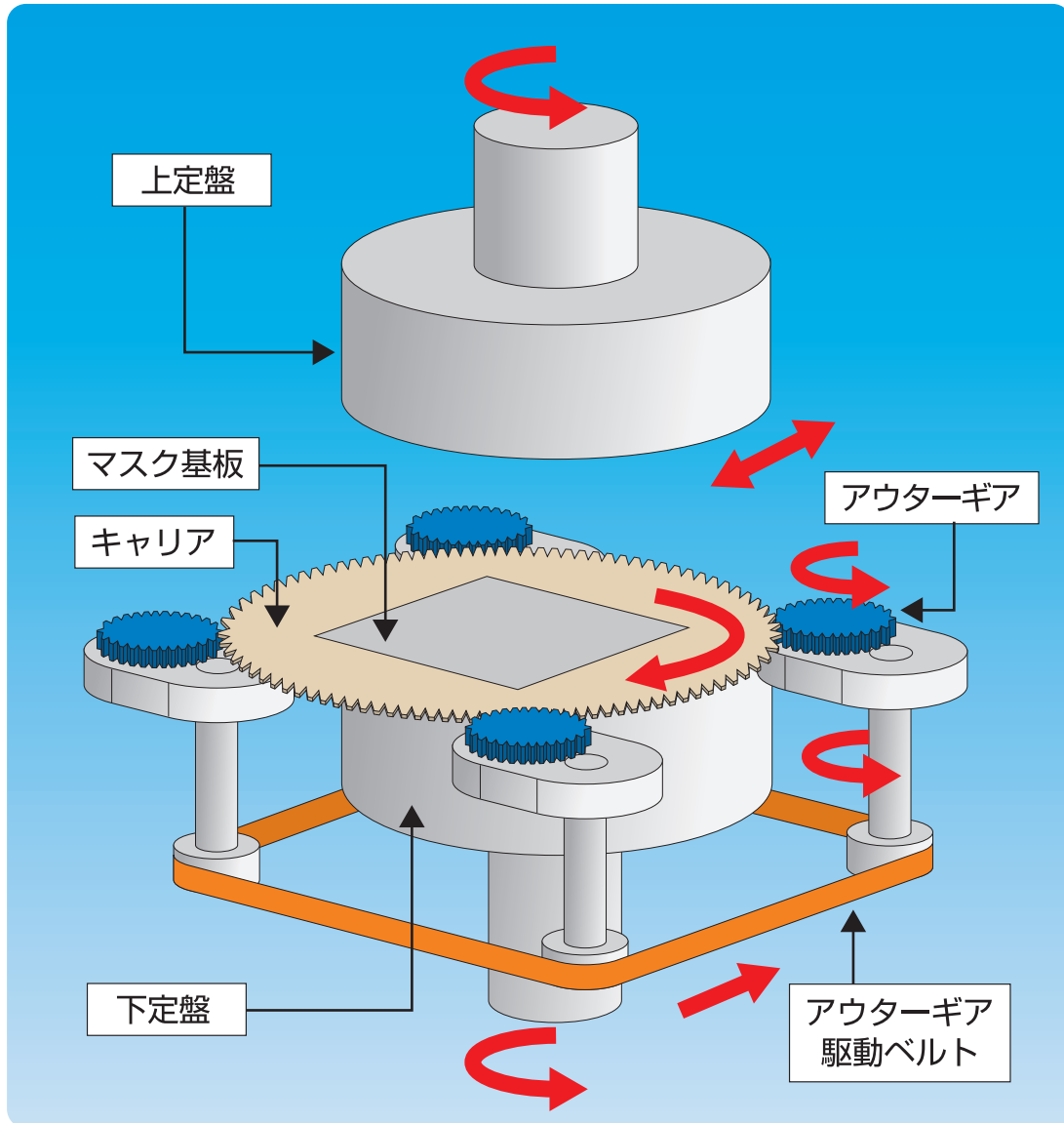


液晶用フォトマスク研磨装置 LMPシリーズ

特長

- 枚葉式で両面同時研磨が可能
- コンパクトなフットプリント
- G10フォトマスク基板対応までラインナップ
- 高精度の研磨が可能
 - ・ キャリアの自転・揺動機構による全面等速度研磨
 - ・ 高精度荷重コントロールによる良好な形状制御性
 - ・ 疵、洗浄に有利なコロイダルシリカ研磨剤を採用



両面研磨装置の機構図